



製品情報  
バージョン 1.2

## ZEISS Axio Imager 2

材料解析を自動化する光学顕微鏡システム



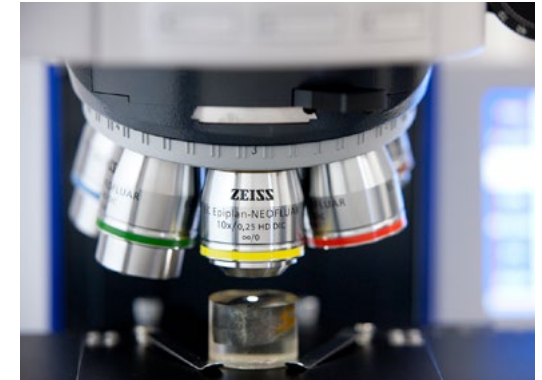
# 材料解析を自動化する光学顕微鏡システム

- › 概要
- › 特長
- › アプリケーション
- › システム構成
- › 技術仕様
- › サービス

ZEISS AxioImager 2 は、業界基準に則る必要のある材料解析、新素材の開発、品質管理に適したシステムプラットフォームです。

本システムは高い光学性能を有し、常に鮮明な画像を得ることができます。特に、円偏光微分干渉（C-DIC）や偏光などの高度なコントラスト技術が使用可能です。

電動スタンドによる照明設定により再現性の高いイメージングが可能です。また、ワークフローを自動化することで常に一貫した結果と高い生産性が得られます。また本システムは、高い拡張性を有するため、様々なアプリケーションに適宜対応していくことができ、幅広いソリューションを網羅的に提供することが可能です。



# より簡単に、インテリジェントに、さらにインテグレートされたシステム

- 概要
- 特長**
- アプリケーション
- システム構成
- 技術仕様
- サービス

## 本顕微鏡システムの特長

研究、開発、不良解析のいずれにおいても、材料用顕微鏡は様々な課題に直面します。ZEISSのAxioImager 2はこれらの課題に対応することができます。アプリケーションに適したコンポーネントを取り付けることにより、粒子解析や、非金属介在物(NMI)解析、液晶、または半導体ベースのMEMなどの解析が可能になります。また、Axio Imager 2は電子顕微鏡検査との相関ワークフローもサポートしています。

## 高度なコントラスト技術をフル活用

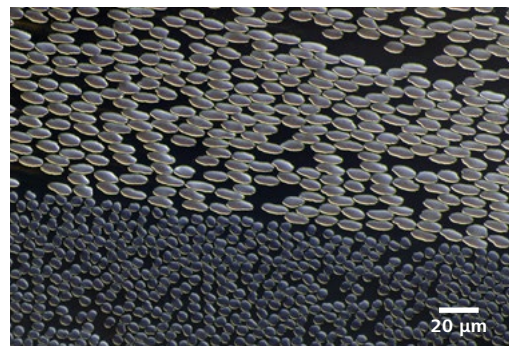
Axio Imager 2では様々なコントラスト技術が利用可能で、各アプリケーションに最適なイメージを提供します。明視野、暗視野、微分干渉(DIC)、円偏光微分干渉(C-DIC)、偏光または蛍光でサンプルの落射光観察ができます。また、透過光を使用する場合、明視野、暗視野、微分干渉(DIC)、偏光、または円偏光が使用可能です。さらに、迷光を最小限に抑えることで均一な照明が得られ、高倍率でも優れたイメージングが可能です。

## 信頼性と再現性のある結果を得る

良い結果を得るためには、システムの安定性が欠かせません。Axio Imager 2の安定したイメージング性能は、高倍率での作業や時間制限がある研究に最適です。また、Axio Imager 2は電動のため、常に一定の条件下で作業しながら、再現性のある結果がスピーディーに得られます。



多種多様な検体用の相関サンプルホルダー付きステージインサート。



炭素繊維強化ポリマー (CFRP)、微分干渉コントラスト (DIC)  
対物レンズ：EC Epiplan-NEOFLUAR 50x/0.8



Axio Imager 2 で安定したイメージング条件をお試しください。

# 可能性を拓く

概要

特長

アプリケーション

システム構成

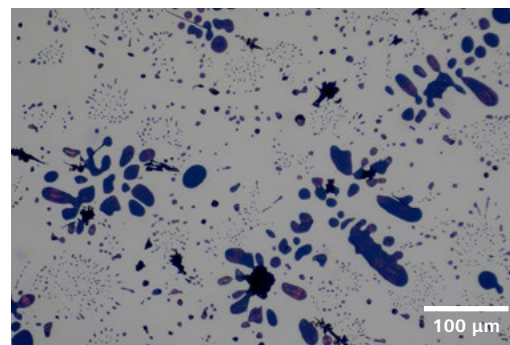
技術仕様

サービス

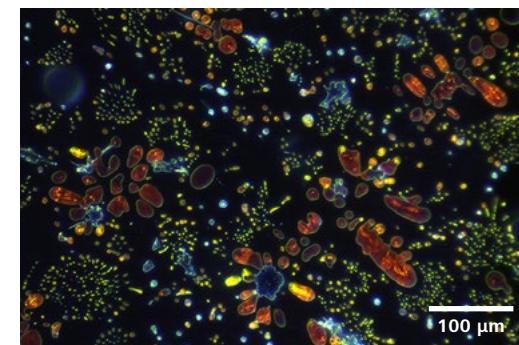
## 高度なコントラスト技術をフル活用

### 明視野と暗視野：最大の均質性と迷光のない画像の背景

Axio Imager2 は、明視野において均一な照明と優れたコントラストを提供します。暗視野においては、迷光による乱れを最小限に抑え、照明光学系の縦色収差を低減することで、観察が難しい試料や微細な構造にも対応することができます。リフレクターターレットを回転するだけでコントラスト法を切り替えることができます。電動スタンドを使用すれば、迅速で快適な作業が可能です。



銅鑄物、明視野  
対物レンズ：EC Epiplan-NEOFLUAR 20x/0.5

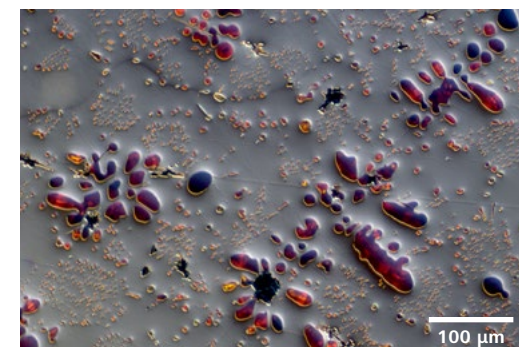


銅鑄物、暗視野  
対物レンズ：EC Epiplan-NEOFLUAR 20x/0.5

### C-DIC: すべての構造に最適

円偏光微分干渉 (C-DIC) は、通常の直線偏光を使用する微分干渉 (DIC) とは異なり、円偏光を使用します。C-DIC は、ランダムな凹凸形状を有するサンプルなどの観察に最適です。直線偏光を使用した DIC と異なり、サンプルをステージ上で回転させる必要はありません。

C-DIC では、サンプルの向きに関わらず、C-DIC のプリズムの位置を調整するだけで、コントラストと分解能において最高品質の画像が得られます。



銅鑄物、C-DIC  
対物レンズ：EC Epiplan-NEOFLUAR 20x/0.5

# 可能性を拓く

› 概要

› **特長**

› アプリケーション

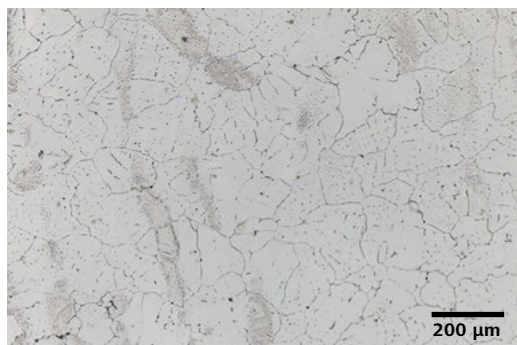
› システム構成

› 技術仕様

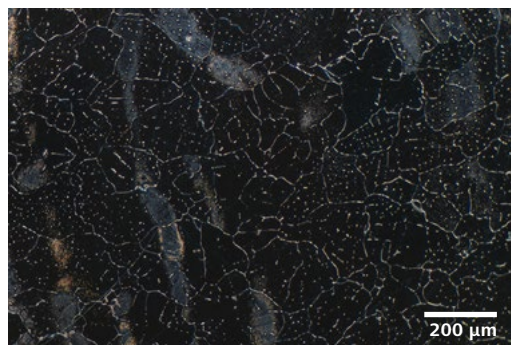
› サービス

## 高度なコントラスト技術をフル活用

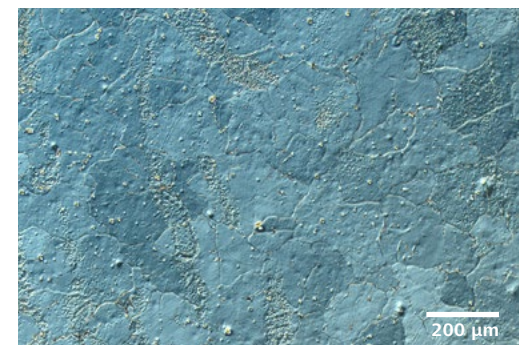
明視野



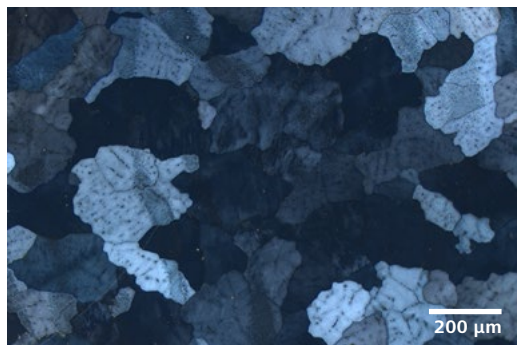
暗視野



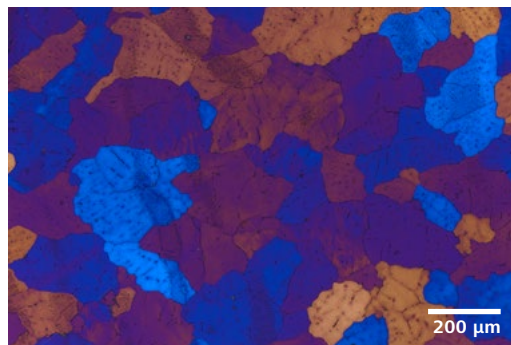
C-DIC



偏光コントラスト



ラムダプレート追加時の偏光



コントラスト技術	反射光	透過光
明視野	●	●
暗視野	●	●
DIC	●	●
C-DIC	●	●
蛍光	●	
位相差		●
偏光	●	●

試料：純アルミニウム、対物レンズ：EC Epiplan-NEOFLUAR 10x/0.25、異なるコントラスト技術を用いて同じ位置で取得

# 多様なアプリケーションに的確に対応

- › 概要
- › 特長
- › **アプリケーション**
- › システム構成
- › 技術仕様
- › サービス

産業および典型的なアプリケーション／試料	タスク	ZEISS Axio Imager 2 の機能
自動車産業	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 複合材料の品質管理と開発</li> <li>■ 溶接部の品質管理</li> <li>■ 介在物と亀裂の検査</li> <li>■ 粒子サイズと非金属介在物の測定</li> <li>■ 粒子解析</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ ハードウェアオートフォーカス</li> <li>■ ZEN core モジュール ZEN Connect を使用した相関顕微鏡</li> <li>■ 偏光コントラストと C-DIC</li> <li>■ ZEN core モジュール：Grains 解析、Cast Iron 解析、NMI 解析、多相解析</li> <li>■ ZEN core モジュール：Technical Cleanliness 解析</li> </ul>
航空および宇宙産業	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 複合材料の品質管理と開発</li> <li>■ 溶接部の品質管理</li> <li>■ 介在物と亀裂の検査</li> <li>■ 粒子サイズと微細構造相の決定</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ ハードウェアオートフォーカス</li> <li>■ ZEN モジュール ZEN Connect を使用した相関顕微鏡</li> <li>■ 偏光コントラストと C-DIC</li> <li>■ ZEN core モジュール：Grains 解析、Cast Iron 解析、NMI 解析、多相解析</li> </ul>
金属製造および加工産業	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 介在物と亀裂の検査</li> <li>■ 粒子サイズと非金属介在物の測定</li> <li>■ 異方性材料の解析</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ ハードウェアオートフォーカス</li> <li>■ ZEN モジュール ZEN Connect を使用した相関顕微鏡</li> <li>■ 偏光コントラストと C-DIC</li> <li>■ ZEN core モジュール：Grains 解析、Cast Iron 解析、NMI 解析、多相解析</li> </ul>
石油、ガス、鉱業	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ テクスチャと微細構造の解析</li> <li>■ 孔の解析</li> <li>■ 蛍光解析</li> <li>■ 2D および 3D イメージング</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ レーザー走査型顕微鏡 LSM 900 MAT</li> <li>■ ZEN モジュール ZEN Connect を使用した相関顕微鏡</li> </ul>
粒子解析	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ ISO 16232、VDA 19 に準拠した清浄度の検査</li> <li>■ ISO 4406、ISO 4407、SAE AS 4059 に準拠したオイルと潤滑油の残留汚染の測定</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ ZEN core モジュール：Technical Cleanliness 解析</li> </ul>
相関顕微鏡	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 光学顕微鏡と電子顕微鏡からの情報の組み合わせ</li> <li>■ 光学顕微鏡と電子顕微鏡間での関心領域の座標の維持</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ ZEN モジュール ZEN Connect を使用した相関顕微鏡</li> </ul>

# 多様なアプリケーションに的確に対応

› 概要

› 特長

› **アプリケーション**

› システム構成

› 技術仕様

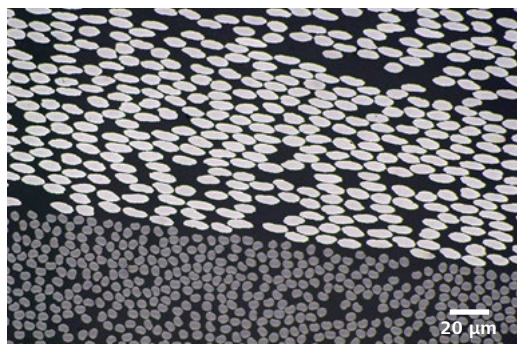
› サービス

産業および典型的なアプリケーション／試料	タスク	ZEISS Axio Imager 2 の機能
非金属介在物 (NMI)	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 鉄鋼の微細構造の定量的および定性的解析</li><li>■ 鉄鋼の純度の測定</li><li>■ 色、明るさ、形状、形成に基づく非金属介在物の含有量と分布の調査</li><li>■ 比較図による含有物の評価</li><li>■ DIN 50602、EN 10247、ASTM E45、ISO 4967、GB/T 10561、SEP 1571 および JIS G 0555 に準拠した硫化物と酸化物の解析</li></ul>	ZEN core モジュール：NMI 解析
3Dトポグラフィー	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 粗さ測定</li><li>■ 高低差の検出</li><li>■ 透明コーティングの厚み測定、表面性状解析</li></ul>	レーザー走査型顕微鏡 LSM 900 MAT
温度顕微鏡	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 金属、結晶、セラミック、ポリマーの挙動に及ぼす温度の影響の調査</li><li>■ 相転移の特定</li><li>■ 相転移の温度の決定</li><li>■ 融点の決定</li></ul>	Linkam 加熱ステージと ZEN core モジュール Linkam

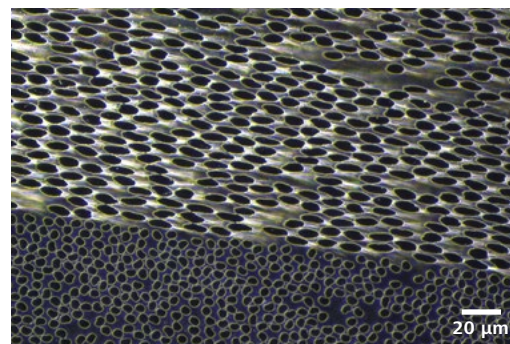
# ZEISS Axio Imager 2 のアプリケーション例

- 概要
- 特長
- アプリケーション
- システム構成
- 技術仕様
- サービス

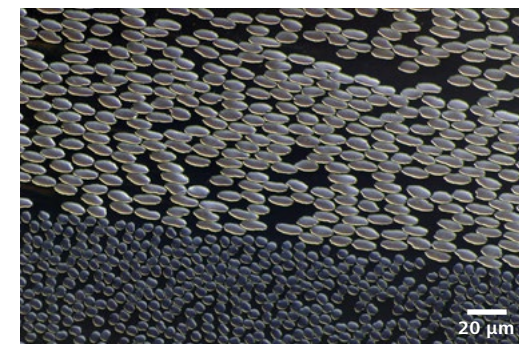
## 航空および宇宙産業



炭素繊維強化ポリマー (CFRP)、明視野  
対物レンズ : EC Epiplan-NEOFLUAR 50x/0.8

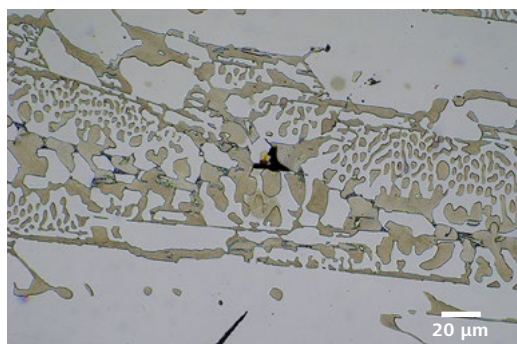


炭素繊維強化ポリマー (CFRP)、暗視野  
対物レンズ : EC Epiplan-NEOFLUAR 50x/0.8

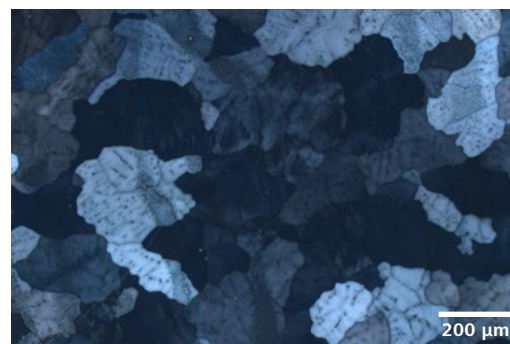


炭素繊維強化ポリマー (CFRP)、DIC  
対物レンズ : EC Epiplan-NEOFLUAR 50x/0.8

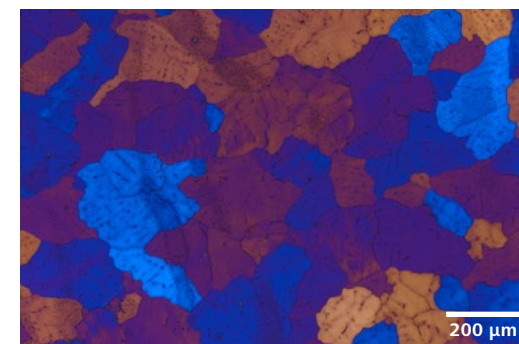
## 金属製造および加工産業



原料鉄、明視野  
対物レンズ : EC Epiplan-NEOFLUAR 50x/0.8



アルミニウム、偏光  
対物レンズ : EC Epiplan-NEOFLUAR 10x/0.25



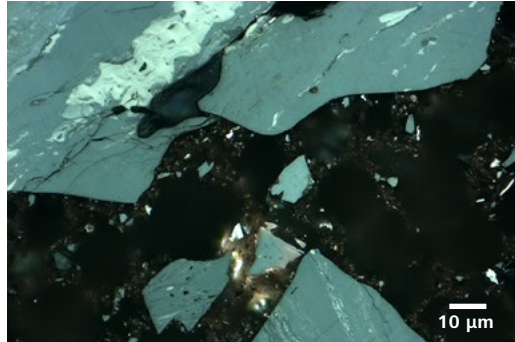
アルミニウム、ラムダプレート使用による偏光  
対物レンズ : EC Epiplan-NEOFLUAR 10x/0.25



# ZEISS Axio Imager 2 のアプリケーション例

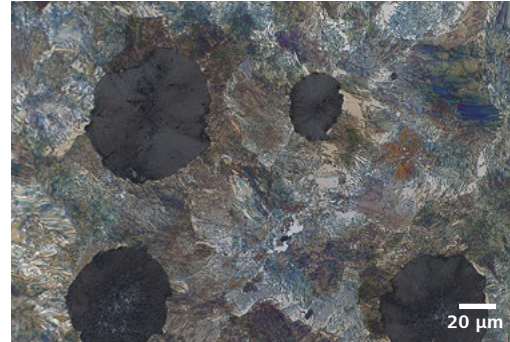
- 概要
- 特長
- アプリケーション
- システム構成
- 技術仕様
- サービス

## 石油、ガス、鉱業



ピトリナイト  
対物レンズ : EC Epiplan-NEOFLUAR 50x/1.0 Oil Pol

## 自動車産業



鋳鉄、明視野  
対物レンズ : EC Epiplan-APOCHROMAT 50x/0.95

## 粒子解析



粒子解析、明視野  
対物レンズ : EC Epiplan-NEOFLUAR 20x/0.5

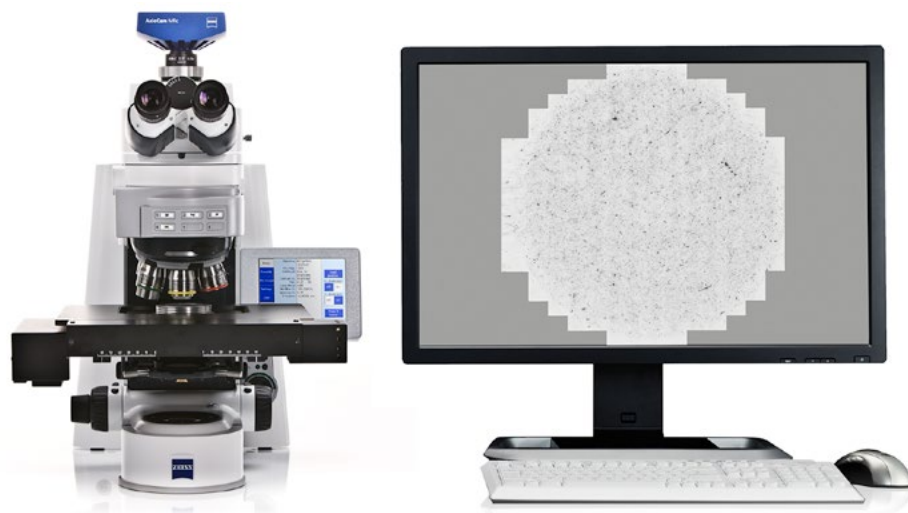
## 可能性を拓く

- › 概要
- › 特長
- › アプリケーション
- › **システム構成**
- › 技術仕様
- › サービス

### コンタミ粒子解析

完全電動光学顕微鏡 Axio Imager 2 は、品質管理に使用されるコンタミ粒子解析システムとしても使用できます。

ZEN core の粒子解析モジュールである Technical Cleanliness Analysis (ZEN core TCA) は、清浄度検査に関する ISO 16232、VDA 19、およびオイル解析に関する ISO 4406、ISO 4407、ならびに SAE AS4059 の規格に準拠し、最小 2  $\mu\text{m}$  のコンタミ粒子の検出が可能です。ZEN core TCA により、解析時の顕微鏡設定が常に正しく設定されているかを確認することができ、誰がオペレーションしても、信頼性と再現性のある結果が得られます。また、ZEN core TCA は、電子顕微鏡との相関解析を行うこともできます。光学顕微鏡で検出されたコンタミ粒子を、電子顕微鏡でイメージングしたり元素分析したりすることが可能です。



# 可能性を拓く

- 概要
- 特長
- アプリケーション
- システム構成**
- 技術仕様
- サービス

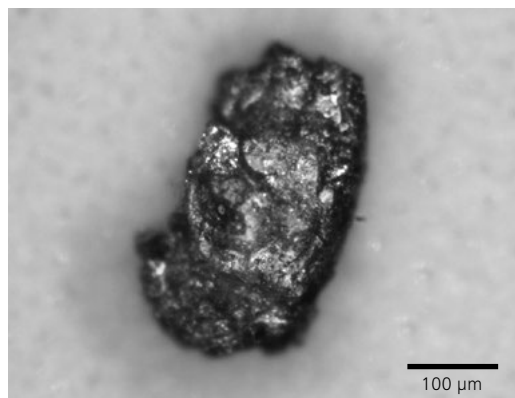
## 相関粒子解析法：さらに多くの情報とより高い品質

ZEISS の相関粒子解析法により、コンタミ粒子の詳細な解析が可能です。Axio Imager 2 で検出した粒子の座標情報は、ZEISS の電子顕微鏡で共有することができます。従って、Axio Imager 2 により同定された特定の粒子を、電子顕微鏡によりイメージしたり、EDX により元素分析したりすることが可能です。また、光学顕微鏡と電子顕微鏡双方からの分析結果を自動的にレポート出力することができます。

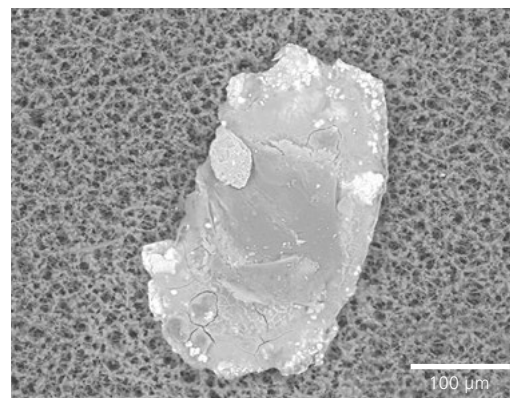
インタラクティブなオーバービューモードでは、光学顕微鏡と電子顕微鏡の測定結果を組み合わせることで評価することが可能です。ワンクリックで粒子を認識し EDX 分析が自動的にスタート、その後自動的にレポートを作成します。このような相関粒子解析法により、製造工程に重大な影響を与える恐れのあるコンタミに対し、スピーディーに対策をとることができます。



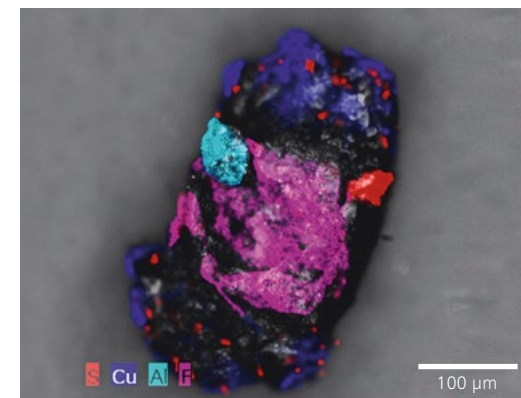
ZEISS 相関粒子解析法の専用サンプルホルダー



光学顕微鏡で取得した金属粒子の画像



電子顕微鏡で取得した同じ金属粒子の画像



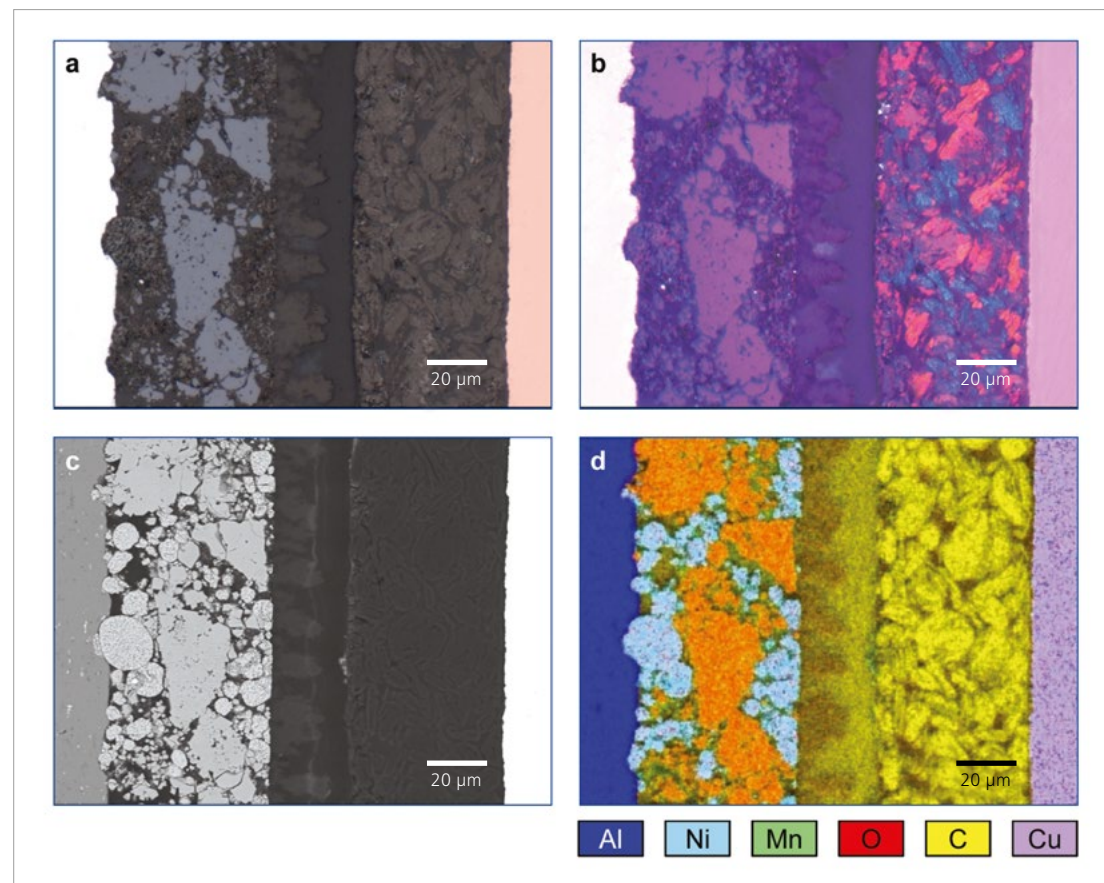
EDX 分析による元素分析マップと光学顕微鏡像の重ね合わせイメージ (元素分析マップ：Bruker Esprit ソフトウェアで作成)

## 可能性を拓く

- 概要
- 特長
- アプリケーション
- システム構成**
- 技術仕様
- サービス

### ZEISS Axio Imager 2 ZEN Connect モジュールによる相関顕微鏡法 (CLEM : Correlative Light and Electron Microscopy) : ミクロ世界とナノ世界をつなぐもの

ZEN Connect モジュールにより、光学顕微鏡と電子顕微鏡のイメージングと分析を効果的に組み合わせることが可能です (CLEM : Correlative Light and Electron Microscopy)。本モジュールにより、光学顕微鏡から電子顕微鏡へ、またはその逆へ、使いやすく生産性の高いワークフローが使用可能です。二つのシステム間で、秒単位で関心領域を正確に呼び出すことができるため、生産性が向上します。目視で簡単に識別できるようなサンプルのシミ状の変色も、モノクロの世界の電子顕微鏡だけでは正確な位置をとらえるのは困難です。しかし、ZEN Connect による CLEM では、Axio Imager 2 で関心領域の座標を保存し、その座標データごとサンプルを電子顕微鏡に移すことができますので、電子顕微鏡でも関心領域にスムーズに移動することが可能です。ZEN Connect により、高い再現性の維持と高効率化が可能です。材料解析アプリケーションの新しいスタンダードとなり得ると考えられます。



CLEM (Correlative Light and Electron Microscopy) による、経年劣化したリチウムイオン電池の関心領域のイメージ。光学顕微鏡の明視野像 (a) と偏光像 (b)、SEM の BSE 信号 (c) と EDS マッピング (d)。

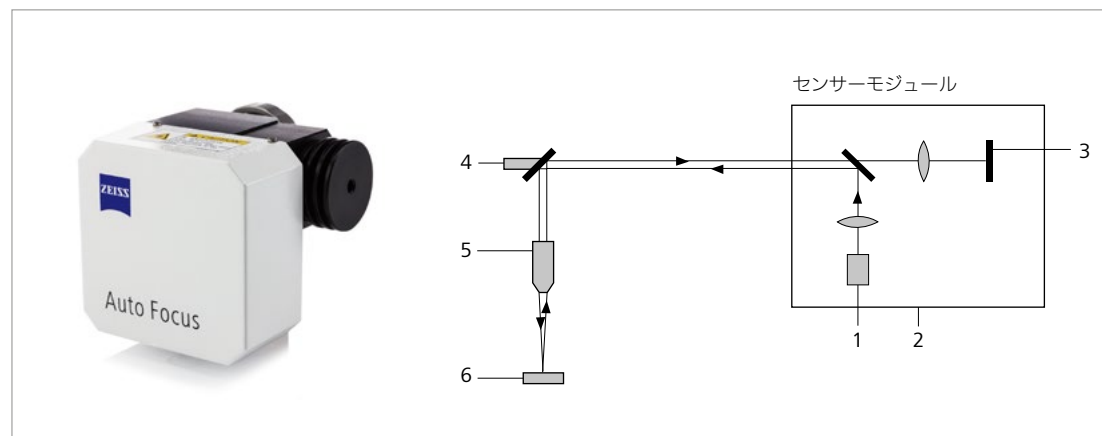
## 可能性を拓く

- › 概要
- › 特長
- › アプリケーション
- › **システム構成**
- › 技術仕様
- › サービス

生産ラインでの検査（例えば、金属組織試験や研磨またはウエハなどの反射光による低コントラスト試料の表面検査）では、対物レンズの焦点深度の最大 0.3 倍の高精度なフォーカシング機能が必要です。Axio Imager 2 は、オプションの Auto Focus システムで、最大 12,000  $\mu\text{m}$  の幅広い領域にわたる迅速かつ正確な焦点合わせを可能とします。Auto Focus システムは反射光や透過光での明視野、暗視野、偏光及び DIC で使用できます。

### 仕組み

Auto Focus システム内の LED の光がサンプルに照射されると、サンプル表面からの反射光がセンサーまで戻ってきます。このプロセスの中で Auto Focus は信号を絶えず分析し、フォーカスドライブに対して適切な制御信号を送り、サンプル表面に焦点を合わせます。Auto Focus センサーはフォーカス位置の変化やずれを検知し、これを自動的に補正します。本システムは対象サンプルに応じて、試料特性に合わせたモード（反射光 / 部分反射光 / 散乱光）と、精度レベル（精密度重視 / バランス重視 / スピード重視）を切り替えることができます。



Auto Focus システムの仕組み：1) LED 2) センサーモジュール 3) センサー 4) ビームスプリッター 5) 対物レンズ 6) 試料

対物レンズ倍率	$\mu\text{m}$ 単位の最大キャプチャ範囲（反射平面）	焦点位置の最大精度（対物レンズの被写界深度の約 0.3 倍）（ $\mu\text{m}$ ）	焦点を合わせるオブジェクトの最小サイズ（ $\mu\text{m}$ ）
1.25x	>12000	~170.00	~2000
2.5x	>10000	~42.00	~1000
5x	>10000	~8.90	~500
10x	>8000	~2.50	~250
20x	>4000	~0.60	~125
50x	>700	~0.25	~50
100x	>150	~0.20	~25

# フレキシブルな構成

- 概要
- 特長
- アプリケーション
- システム構成**
- 技術仕様
- サービス

## 1 顕微鏡

- Axio Imager.A2m (エンコード式)
- Axio Imager.M2m (電動、透過光観察手動)
- Axio Imager.Z2m (電動、透過光観察電動)

## 2 対物レンズ

反射光

- EC EPIPLAN
- EC Epiplan-NEOFLUAR
- EC Epiplan-APOCHROMAT

透過光

- N-ACHROPLAN
- EC Plan-NEOFLUAR
- Plan-APOCHROMAT
- C-APOCHROMAT
- FLUAR

長焦点

- LD EPIPLAN
- LD EC Epiplan-NEOFLUAR

## 3 光源

反射光

- MicroLED
- VisLED
- ハロゲン
- HBO / HXP

透過光

- MicroLED
- VisLED
- ハロゲン



## 4 カメラ

- 各種 AxioCam シリーズ

## 5 ソフトウェア

- ZEN core
- ZEN starter

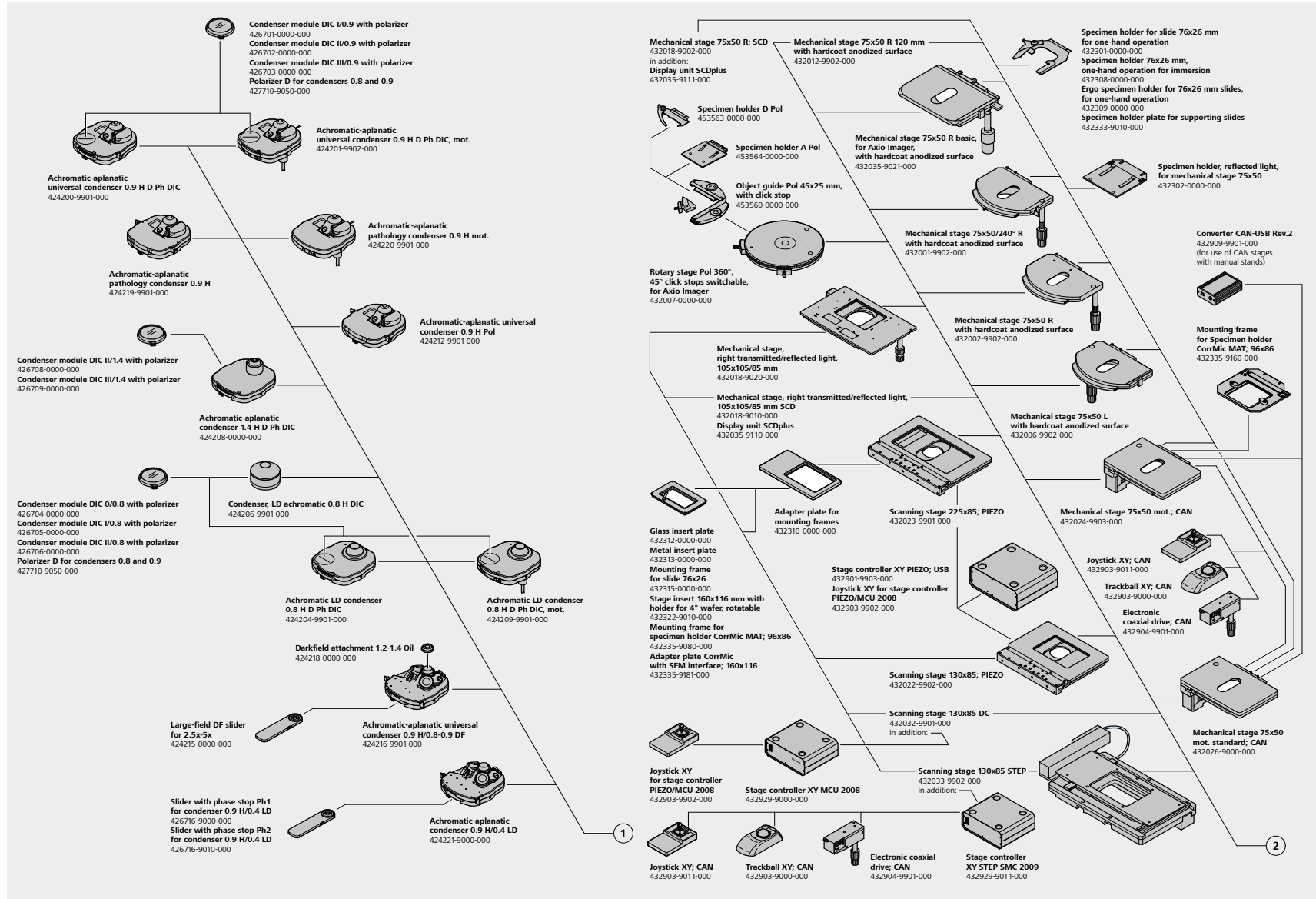


## 6 アクセサリ

- Auto Focus
- Linkam 社製加熱および冷却ステージ
- フォーカスリニアセンサー
- 相関顕微鏡

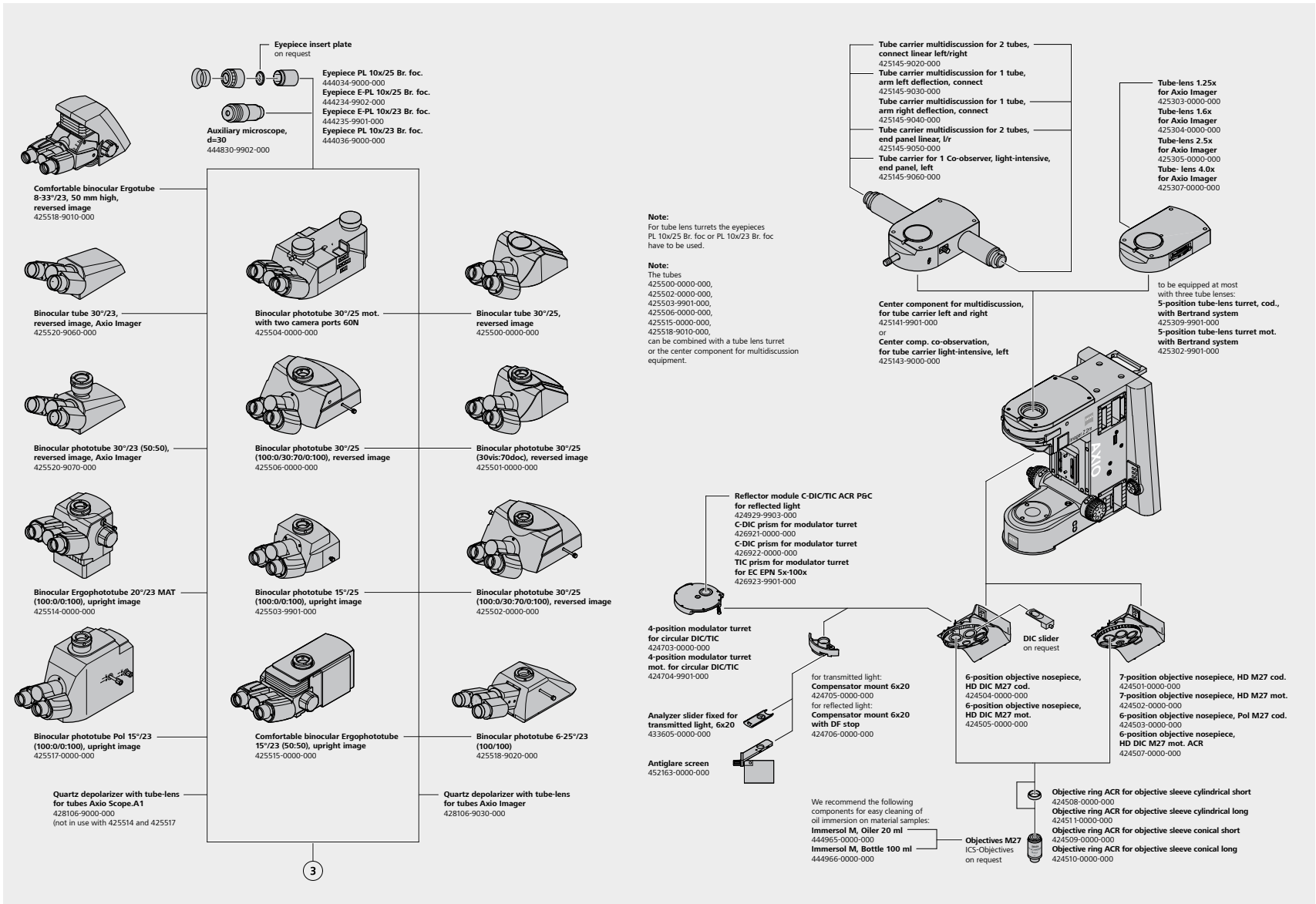
# システム概要

- ▶ 概要
- ▶ 特長
- ▶ アプリケーション
- ▶ システム構成
- ▶ 技術仕様
- ▶ サービス



# システム概要

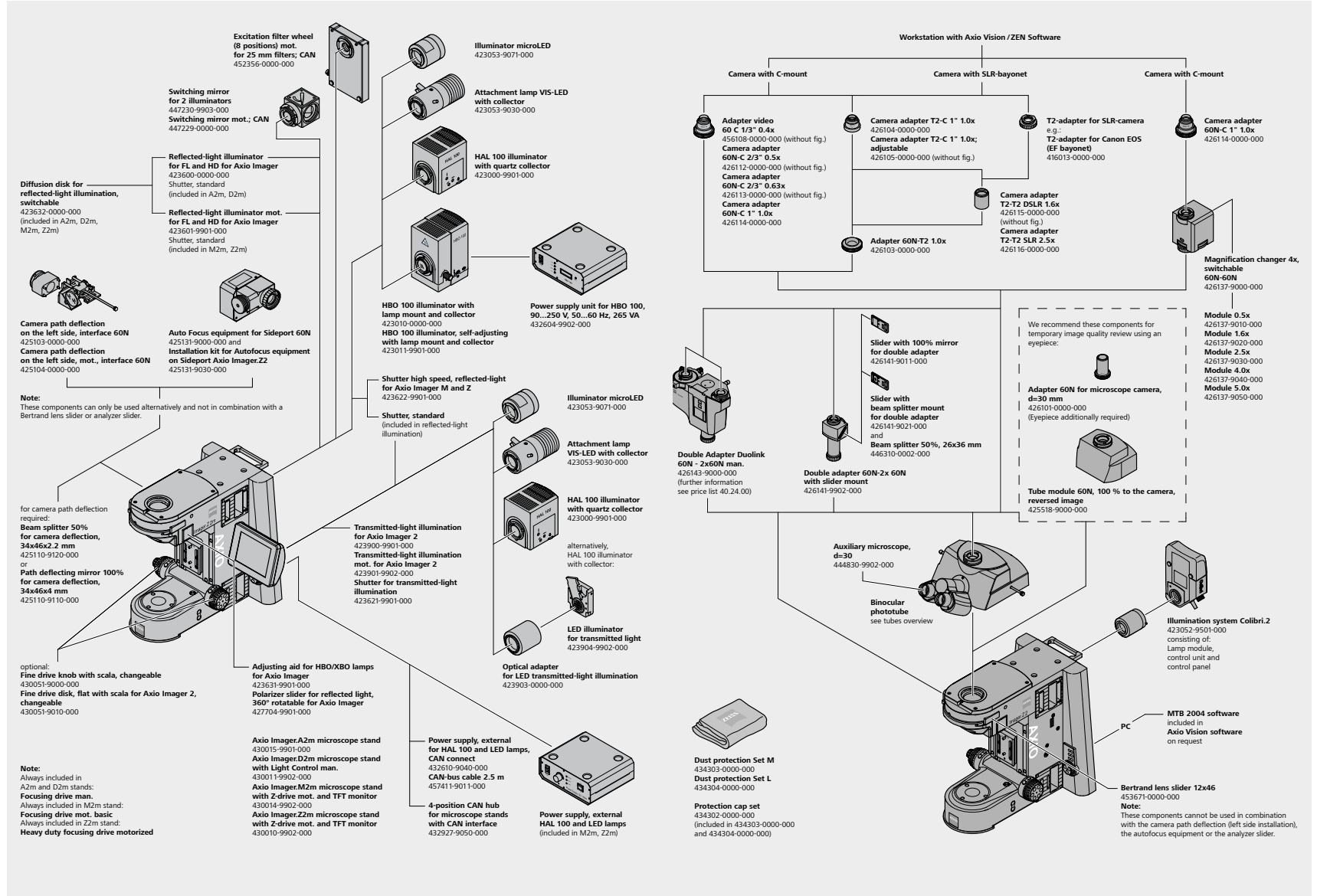
- ▶ 概要
- ▶ 特長
- ▶ アプリケーション
- ▶ システム構成
- ▶ 技術仕様
- ▶ サービス





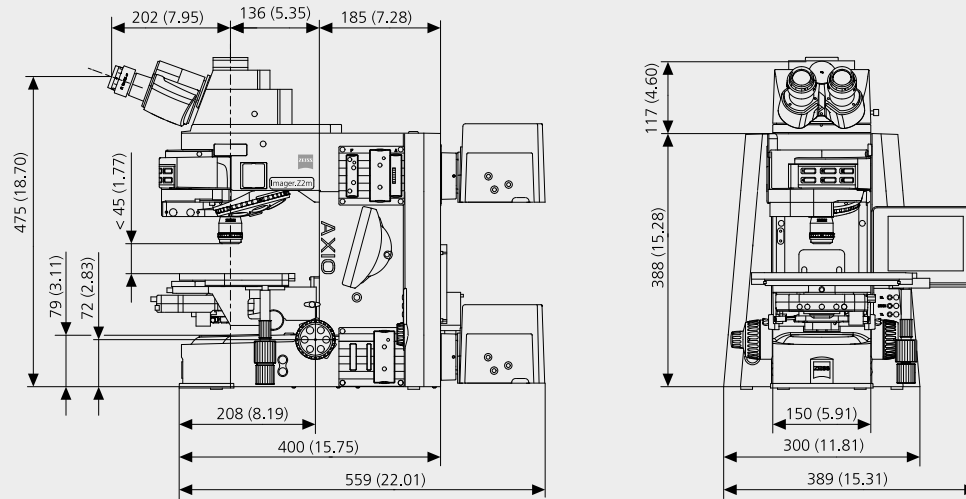
# システム概要

- › 概要
- › 特長
- › アプリケーション
- › システム構成
- › 技術仕様
- › サービス



# 技術仕様

- › 概要
- › 特長
- › アプリケーション
- › システム構成
- › 技術仕様
- › サービス



鏡基	Axio Imager.A2m	Axio Imager.M2m	Axio Imager.Z2m
コントラストマネージャー		●	●
ライトマネージャー	●	●	●
TFT ディスプレイ		●	●
リモートコントロール		○ (ドッキングステーション)	○ (ドッキングステーション)

- 付属
- オプション

# 技術仕様

- 概要
- 特長
- アプリケーション
- システム構成
- 技術仕様**
- サービス

寸法（幅 x 奥行 x 高さ）	
Axio Imager スタンド、HBO100 付き（手動）	約 300 mm x 721 mm x 505 mm
Axio Imager スタンド、HBO100 および TFT ディスプレイ付き（電動）	約 390 mm x 721 mm x 505 mm

重量	
Axio Imager、手動 / 電動（機器によって異なります）	約 18 ~ 40 kg

周囲条件輸送（パッケージ内）：	
許容環境温度	-40 ~ +70 °C

保管	
許容環境温度	+10 ~ +40 °C
許容相対湿度（結露なきこと）	35 °C で最大 75%

動作環境	
許容環境温度	+10 ~ +40 °C
許容相対湿度	35 °C で最大 75%
気圧	800 hPa ~ 1060 hPa
使用可能な高度	最大 2000 m
汚染度	2

# 技術仕様

- 概要
- 特長
- アプリケーション
- システム構成
- 技術仕様**
- サービス

## 内蔵電源を備えたコード化された Axio Imager、または VP232-2 外部電源を使用する電動 Axio Imager の動作データ

動作環境	密室
保護クラス	I
保護タイプ	IP 20
電気的安全性	CSA および UL 指令を含む DIN EN 61010-1 (IEC 61010-1) に準拠
過電圧カテゴリ	II
電波干渉抑制	EN 55011 クラス B に準拠
ノイズ耐性	DIN EN 61326-1 に準拠
一体型電源の線間電圧	100 ~ 127 および 200 ~ 240 V ± 10% 線間電圧設定の変更は不要
外部電源 VP232-2 の線間電圧	100 ~ 240 V ± 10%
線間周波数	50/60 Hz
コード化された Axio Imager の最大消費電力	最大 260 VA
Axio Imager の消費電力、電動式	最大 190 VA
LED イルミネーター	400 ~ 700 nm、ピーク波長 460 nm
アタッチメントランプ VIS-LED	400 ~ 700 nm、ピーク波長 460 nm

## トランス HBO 100

動作環境	密室
保護クラス	I
保護タイプ	IP 20
線間電圧	100 VAC ... 240 VAC
線間周波数	50/60 Hz
HBO100 使用時の消費電力	155 VA

## IEC127 に準拠したヒューズ

Axio Imager 顕微鏡スタンド、手動	T 5.0 A/H / 250V, 5 x 20 mm
Axio Imager 用電源 VP232-2、電動	T 4.0 A / 250V, 5 x 20 mm
トランス HBO 100	T 2.0 A/H, 5 x 20 mm

# 技術仕様

- › 概要
- › 特長
- › アプリケーション
- › システム構成
- › **技術仕様**
- › サービス

## 光源

ハロゲンランプ	12 V/100 W
光源調節	連続、約 0.7 ~ 12 V
水銀蒸気ショートアークランプ	HBO 103 W/2
HBO の消費電力 103W/2	100 W

## Axio Imager (コード化)

手動ステージフォーカシング付きスタンド	粗動	約 2mm/ 回転
	微動	約 1/10 ギア伝達比
	上下動範囲	最大 25 mm
	上限リミッター	機械的に調整可能
Achromatic-aplanatic ユニバーサルコンデンサー 0.9 H D Ph DIC、 スイベルタイプのフロントレンズ、Achromatic-aplanatic 0.9 DIC	対物レンズの倍率が 10 倍未満の場合	フロントレンズ 0.9 が旋回
	対物レンズ倍率が 10 倍以上の場合	フロントレンズ 0.9 は 8 ポジションタレットディスクで旋回
対物レンズ交換	手動	6 ポジションまたは 7 ポジションのノーズピース、HD または HD DIC M27 経由
メソッドモジュールの変更	手動	6 ポジションリフレクタータレット経由

## Axio Imager (電動)

電動ステージフォーカシング付きスタンド	ステップモーターの平均ステップサイズ	25 nm (Axio Imager.M2) 10 nm ± 10 (Axio Imager.Z2)
	ステージの迅速な下降 / 上昇	10 mm
	上下動範囲	25 mm
	上限リミッター	電子
	フォーカシングスピード	変数
Achromatic-aplanatic ユニバーサルコンデンサー 0.9 H D Ph DIC、電動 式スイベルタイプのフロントレンズ、Achromatic-aplanatic 0.9 DIC	対物レンズの倍率が 10 倍未満の場合	フロントレンズ 0.9 が旋回
	対物レンズ倍率が 10 倍以上の場合	フロントレンズ 0.9 は 8 ポジションタレットディスクで旋回
対物レンズ交換	手動または電動	6 ポジションまたは 7 ポジションのノーズピース経由
メソッドモジュールの変更	手動	6 ポジションリフレクタータレット経由
	電動	6 ポジションまたは 10 ポジションのリフレクタータレット 経由
	手動 / 電動	DIC または C-DIC モジュールータレット経由
スキャンステージの高性能フォーカス	重量 5 kg までの試料に適用可能	

# 文字通り信頼のおけるサービス

- 概要
- 特長
- アプリケーション
- システム構成
- 技術仕様
- サービス**

ZEISS 顕微鏡システムがおお客様の最も重要なツールのひとつであると考え、私たちはお使いの機器が常に最適な状態であるようサポートします。私たちにとって大切なのはおお客様の出される結果です。豊富な経験と知識を持つ ZEISS の専門家により多岐にわたるサービスを通じて、長い期間にわたってサポートいたします。私たちの願いはお客様がお使いの顕微鏡から期待しうる最高の結果を出されることです。

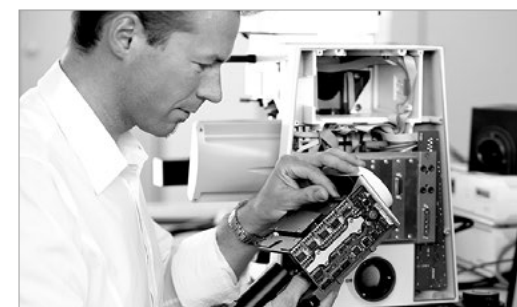
## 修理、メンテナンス、最適化

お使いの顕微鏡を常に最適な状態に保ちます。ZEISS 保守サービス契約によりダウンタイムを減らし、システムの性能改善により最高の結果を得ることが可能となります。さまざまなオプションと点検作業内容を含んだ幅広いレンジからサービス契約をお選びいただけます。ニーズに合わせてお客様専用のサービスプログラムの選択が可能となっております。

オンデマンドサービスも勿論、受け付けております。ご要望にあわせて遠隔メンテナンスソフトウェアを通して、あるいは現場で直接、ZEISS サービスエンジニアが問題を分析し解決します。

## ご使用中の顕微鏡システムを強化

ZEISS 顕微鏡システムは各種アップデートに対応できるように設計されており、オープンインターフェイスで常に最高のレベルを保つことが可能となっております。結果的に作業はより効率的になり、更なるアップデートの可能性が加わることによって顕微鏡の生産性とライフタイムを伸ばすことが可能です。



ZEISS のサービスによって最適化された顕微鏡システムのパフォーマンスは改善され、大きなメリットを生み出します。

>> [www.zeiss.com/microservice](http://www.zeiss.com/microservice)



**Carl Zeiss Microscopy GmbH**  
07745 Jena, Germany  
microscopy@zeiss.com  
www.zeiss.com/axioimager-mat

カールツァイス株式会社  
リサーチマイクロスコピーソリューションズ  
info.microscopy.jp@zeiss.com  
<https://www.zeiss.co.jp/microscopy>

